

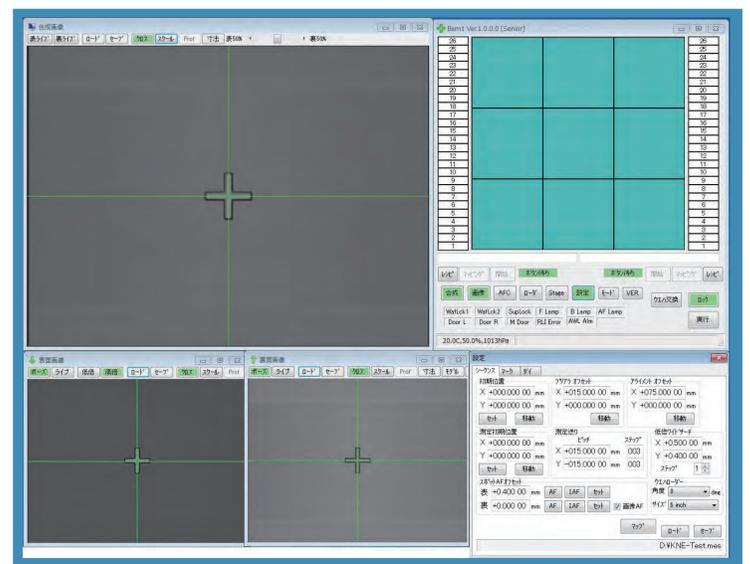
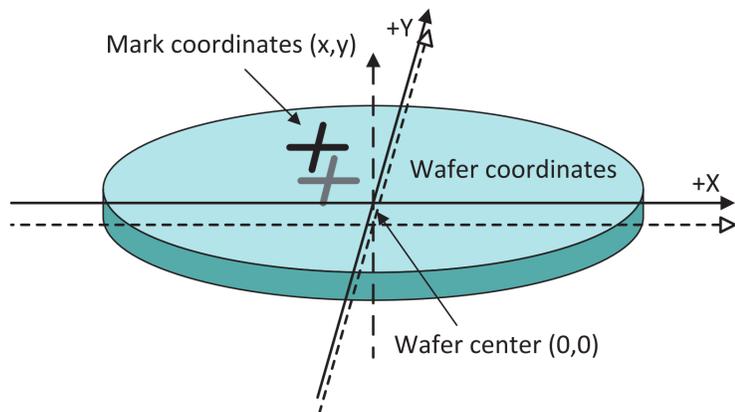
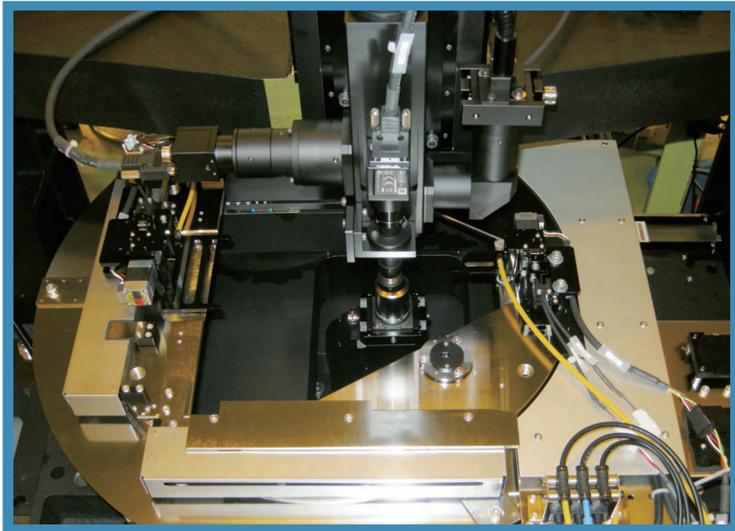
Both Side Measuring System BSM

両面座標測定機 BSM



高精度ステージ(干渉計)、両面光学系検出方式
Incorporated interferometer, Built-in microscopes

- $\phi 200\text{mm}$ 以下試料の表裏両面パターン間座標偏差の測定を実現
(測定再現性 $3\sigma \leq 100\text{nm}$)
- 座標偏差出力値から系統誤差分析が可能
- 露光機と連携運用(オプション)



試料の表裏両面パターンの光学顕微観察によるCNC二次元直交座標偏差値を出力するリファレンスツールとして活用できます

安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
カタログ記載の内容は2017年5月現在のものです。製品の価格、仕様、外観は製造者/販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。

株式会社 **ニコンテック**

〒140-0012

東京都品川区勝島1丁目5番21号(東神ビル)6F
TEL (03)5762-8976 FAX (03)5762-8920

<https://www.nikontec.co.jp/index.htm>